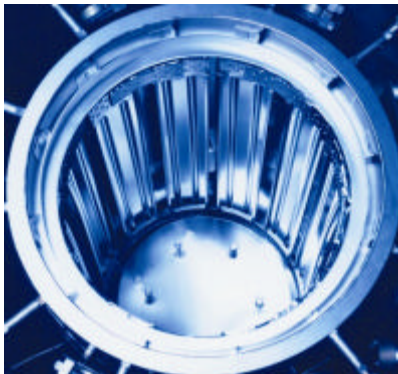
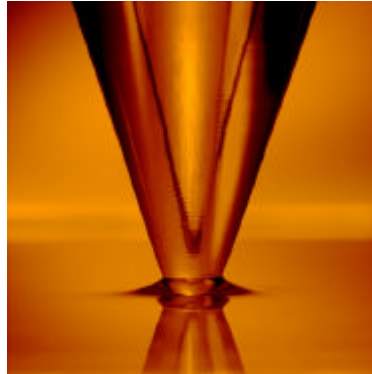


- Be Equipped for Tomorrow's Materials -



Vakuum-Anlagen



Kristallzucht-Anlagen



Plasma-Anlagen

**HGB Einzelabschluss 2003
der PVA TePla AG**

Lagebericht 2003 der PVA TePla AG

1. Einleitung

Der vorliegende Lagebericht beschreibt die Geschäftsentwicklung der **PVA TePla AG** („PVA TePla“ oder „Gesellschaft“) im ersten vollen Geschäftsjahr nach der Verschmelzung der PVA Vakuum-Anlagenbau GmbH („PVA“) und der TePla AG („TePla“) am 5. November 2002.

Die PVA TePla ist ein weltweit agierender Anbieter von Systemen für die Herstellung von hochwertigen Werkstoffen wie Metalle, Halbleiter, Keramiken, Gläser, aber auch für die kontrollierte Oberflächen-Behandlung dieser Materialien und verschiedenster Kunststoff-Oberflächen. Derartige Produktions- und Behandlungsprozesse erfordern stabile, reproduzierbare Bedingungen. Sie finden daher meist im Vakuum, bei hohen Temperaturen und/oder mit Unterstützung eines Niederdruck-Plasmas statt.

Die PVA TePla ist Systemanbieter für Vakuumanlagen, die High Tech-Materialien und Oberflächen im Vakuum bei hohen Temperaturen und im Plasma erzeugen und bearbeiten.

Der Markt für diese Systeme ist weltweit immer mit den neuesten Entwicklungen der Material- und Oberflächen-Technologie verbunden, wie zum Beispiel 157 nm-Technologie für schnellere Chips, Dieselabgasfilter für PKW, Strukturwerkstoffe für Weltraumspiegel, Produktionstechnologien für flache Bildschirme. Er wird existieren, solange High Tech-Werkstoffe hergestellt und weiter entwickelt werden.

Die Gesellschaft gliedert ihre Geschäftsaktivitäten und somit ihre Berichterstattung in drei Geschäftsbereiche (GB): **Vakuum-Anlagen, Kristallzucht-Anlagen und Plasma-Anlagen.**

Der Jahresabschluss der Gesellschaft umfasst die ehemalige PVA (GB Vakuum-Anlagen) und die ehemalige TePla (GB Plasma-Anlagen). Die diesen beiden GB zuzurechnenden Tochtergesellschaften sowie die Crystal Growing Systems GmbH (GB Kristallzucht-Anlagen) werden im Jahresabschluss als verbundene Unternehmen ausgewiesen.

Da die Verschmelzung der PVA auf die TePla im Vorjahr mit wirtschaftlicher Rückwirkung auf den 1. Januar 2002 durchgeführt wurde, beinhalten die Vorjahreszahlen den gesamten 12-Monatszeitraum.

2. Unternehmensentwicklung in schwierigem weltwirtschaftlichen Umfeld

Das Berichtsjahr 2003 war für das neue Unternehmen in Folge der Verschmelzung aber auch der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine besondere Herausforderung.

Die nach der Fusion und zum Ende des Vorjahres beschlossenen und sukzessive eingeleiteten **Restrukturierungs- und Anpassungsmaßnahmen** im Konzern, die im Wesentlichen den Abbau von Personal- und Standortkapazitäten aber auch eine gezieltere Steuerung von Vermarktungsaktivitäten und bei Forschung und Entwicklung betreffen, konnten zu weiten Teilen umgesetzt werden. Für die Gesellschaft bedeutete dies konkret die Schließung der Betriebsstätte in Kahla und die Verkleinerung der genutzten Betriebsflächen am Standort Feldkirchen, die Reduktion der Mitarbeiterzahl der ehemaligen PVA um gut 15% und der ehemaligen TePla um mehr als 28% sowie die

Reduktion der F&E-Kosten der ehemaligen TePla durch straffere Projektführung und -auswahl in 2003. Außerdem wurden für nachhaltig ungenutzte Mietflächen Drohverlustrückstellungen für die Folgejahre gebildet.

Weitere Maßnahmen - insbesondere den GB Kristallzucht-Anlagen (Crystal Growing Systems GmbH), aber aufgrund der noch schwachen Nachfrageentwicklung auch die ehemalige TePla betreffend - müssen im Geschäftsjahr 2004 umgesetzt werden. Dabei wird streng darauf geachtet, dass durch den Abbau von Kapazitäten kein Nachteil entsteht, der ein rasches Wachstum des Unternehmens bei anziehender Konjunktur und steigender Nachfrage verhindern könnte.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2004 wurde die Konzernstruktur in den USA durch die Verschmelzung der PVA USA Corp. auf die TePla America Inc. zur PVA TePla America Inc. gestrafft. Planmäßig wurde durch Ausüben einer Call Option ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 2004 auch deren Geschäftsanteil an der PVA MIMtech LLC von 25% auf 50% erhöht.

Der Optimierung und Beschleunigung der Geschäftsprozesse wirkten neben Widerständen durch unterschiedliche, landesspezifisch geprägte Unternehmenskulturen besonders auch die anhaltende Rezession der Weltwirtschaft und die Nachfrageschwäche auf den technologie- und innovationsorientierten Märkten entgegen.

Das ehrgeizige Ziel des Vorstandes und der Mitarbeiter, schon im ersten Jahr nach der Fusion im operativen Bereich "break-even" zu erreichen, konnte daher nicht umgesetzt werden.

3. Entwicklung der Wirtschaft und der Branchen

Die weltweite wirtschaftliche Entwicklung stagnierte bis zur Mitte des Berichtsjahres auch weiterhin, belebte sich danach jedoch besonders im Bereich der Produktion stetig. Das Geschäfts- und Konsumklima verbesserte sich, und die Aktienkurse stiegen. Die Auslastung der Produktionen nahm bis zum Ende des Jahres stetig zu, die brach liegenden Kapazitäten wurden wieder belebt. Naturgemäß führte dies jedoch nicht zu einem parallel verlaufenden Anstieg der Nachfrage nach Investitionsgütern in unseren Branchen. Auch verlief die Belebung - anders als der Abschwung der letzten Jahre - nicht in allen Ländern annähernd gleichzeitig. Vorreiter für die konjunkturelle Erholung waren die USA, die durch eine sehr expansiv ausgerichtete Makropolitik die Binnennachfrage kräftig erhöhten. Der Euro-Raum ist konjunkturell ein Nachzügler, der auch unter der deutlichen Aufwertung des Euro besonders im internationalen Investitionsgütergeschäft stark leidet. Auch die wirtschaftliche Belebung in ostasiatischen Schwellenländern erfolgte nur langsam und wurde im Berichtsjahr durch den immer noch recht hohen Ölpreis und durch die Lungenkrankheit SARS verzögert. Der Anstieg des Bruttoinlandprodukts 2003 betrug laut Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Deutschland rund 0%, in Frankreich ca. 0,3%, in Großbritannien ca. 2%, in den USA hingegen über 3%.

Der Umsatz der Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland sank laut einer Erhebung des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in 2003 real um 1%, nominal lag der Rückgang der Maschinenproduktion (bedingt durch die Euro-Stärke) bei 0,1%. Der Auftragseingang aus dem Ausland stieg in dieser Branche um 3%, im Inland lag der Zuwachs bei 2%; die größte Belebung bei den Bestellungen kam hier jedoch erst zum Jahresende.

Nach zwei sehr schlechten Wirtschaftsjahren, in denen der Philadelphia Semiconductor Index (SOXX) von 1200 Punkten auf 250 Punkte fiel, stoppte die **Halbleiter-Branche** Anfang des Jahres 2003 ihre Talfahrt. Überproduktion und Dumping-Preise verhinderten zunächst den erhofften Aufschwung, was bei vielen Herstellern zu negativen Quartals-

abschlüssen führte. Die erste Hälfte des Jahres 2003 war daher weiterhin durch Kostensenkungsprogramme der großen Chip- und Wafer-Hersteller gekennzeichnet, um wieder in die Gewinnzone zu gelangen. Die weltweiten Umsätze der Chipausrüster in 2003 erfuhren laut einer Erhebung von VLSI Research einen Zuwachs um 4,3% nach einem Rückgang von 32% im Vorjahr.

Die **Hartmetallbranche** produziert im Wesentlichen für den Werkzeugbau. Die Entwicklung dieser Branche läuft überwiegend parallel zu der des Werkzeugmaschinen- und allgemeinen Maschinenbaus aber auch der Fahrzeug- und Baumaschinenbranche. Der Werkzeugmaschinenbau musste nach einer Studie des Verein Deutsche Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) in 2003 einen weltweiten Rückgang um 8% verkraften. Insbesondere das Inlandsgeschäft war mit 14% stark rückläufig, während der Export vor allem aufgrund starker Nachfrage aus China insgesamt nur um 3% nachgab. Beim Auftragseingang zeichnet sich hier seit Mitte des Jahres 2003 eine Wende ab. Die Nachfrage stieg insbesondere aus der Region China, auch Russland landete erstmals seit der Ostöffnung wieder unter den zehn größten Bestellern.

Bei allen Wafer-Produzenten bewegten sich die Investitionen in der **Mikroelektronik Industrie** 2003 auf sehr niedrigem Niveau, d.h. es wurden überwiegend Ersatz-Investitionen getätigt bzw. Reparaturen durchgeführt. Dies gilt nicht nur für die Silizium-Produzenten, sondern ebenfalls für die Hersteller von Verbindungshalbleitern wie Galliumarsenid (GaAs) und Indiumphosphid (InP), die in dieser Krise erstmals ebenfalls einen Rückgang ihrer Umsätze zu verzeichnen hatten. Während in den meisten Regionen der Welt die Halbleiter-Industrie schrumpfte oder stagnierte, setzte sich das seit Jahren überdurchschnittliche Wachstum der Elektronik-Industrie in China und Taiwan weiter fort.

Während der Absatz von Kristallen für die Telekommunikation in 2003 stagnierte, stieg dagegen die Nachfrage nach Substratmaterialien für die Beleuchtungstechnik in der **Optoelektronik**, wie z.B. für Saphir- und Siliziumcarbid (SiC)-Kristalle, weiter.

4. Umsätze

Die Umsätze der PVA TePla im Jahr 2003 beliefen sich auf insgesamt 26,3 Mio. € und lagen damit um 3,5% über dem Vorjahreswert (25,4 Mio. €). Trotz leichter Zuwächse gegenüber dem Vorjahr konnten die GB Vakuum-Anlagen und Plasma-Anlagen die gesetzten Umsatzerwartungen jedoch nicht erfüllen.

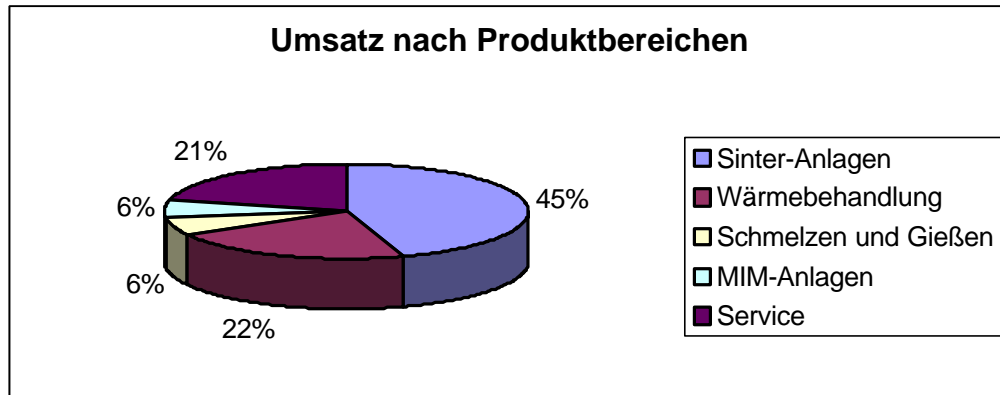
Geschäftsbereich Vakuum-Anlagen:

Im Berichtsjahr erreichte der Umsatz 18,0 Mio. € und zeigt damit eine leicht steigende Tendenz von plus 2,9% im Vergleich zum Vorjahr (17,5 Mio. €), lag aber dennoch rund 23% unter den Erwartungen. Diese Nichterreicherung der Planwerte ist wie im Vorjahr überwiegend bedingt durch weiter verschobene Investitionen und Nicht-Umsetzung von geplanten Investitionsprojekten unserer Kunden weltweit. Mit mehr als hälftigem Anteil am Minderumsatz ist hierbei ein Projekt zum weiteren Ausbau der Produktionskapazität für die thermische Behandlung mineralischer Kristalle für Stepper-Optiken (Mikrolithographie) nennenswert, das nach einem Investitionsstop in 2002 zur Fortführung in 2003 angekündigt war, jedoch aufgrund der auch in 2003 äußerst angespannten Lage auf dem Halbleitermarkt nicht zur Umsetzung kam.

Das Anlagengeschäft trug mit 14,2 Mio. € (VJ 12,8 Mio. €) zum Geschäftsbereichsumsatz bei und verteilte sich wie folgt:

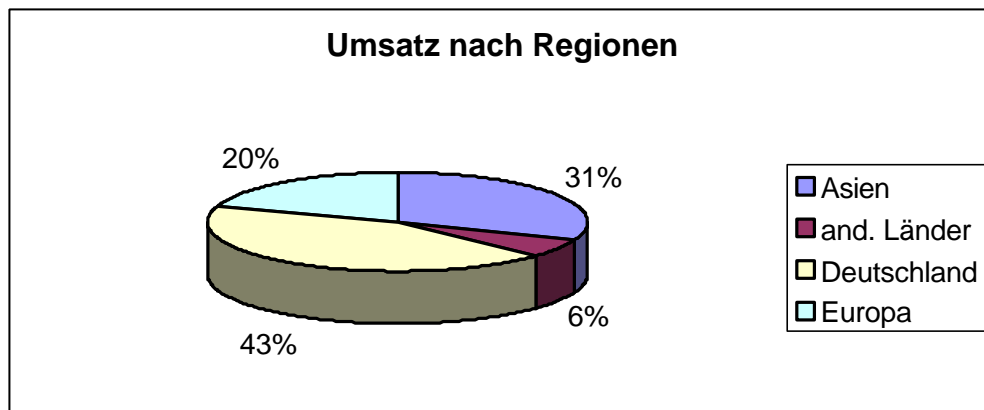
- 45% Sinteranlagen für die Hartmetallbranche (VJ 39%)
- 22% Wärmebehandlungs- und Löt-Anlagen vom Typ MOV und COV (VJ 21%)
- 6% Vakuum-Schmelz- und Gieß-Anlagen vom Typ VSG (VJ 8%)
- 6% MIM-Sinteranlagen (neuer Produktbereich).

Der Umsatzanteil für Service (Wartung, Ersatzteile, Montagen, Reparaturen) belief sich auf rund 3,8 Mio. € (VJ 4,7 Mio. €) und betrug 21% (VJ 27%) des Geschäftsbereichs-umsatzes.



Von den im Berichtsjahr erhaltenen Anlagenbestellungen konnten in dem selben Geschäftsjahr rd. 32% auch als Umsatz realisiert werden (VJ 18%).

Der Exportanteil für Anlagen lag bei rund 57% (VJ 62%), davon entfielen 20% auf Europa (VJ 37%), 31 % auf Asien (VJ 20%) - darin China 23 % (VJ 16%) - und 6% auf andere Länder (VJ 14%).



Im Jahr 2003 wurden folgende hervorzuhebende Projekte für spezielle Materialien und Anwendungen erfolgreich abgeschlossen:

Innovative Anlagentechnik für neue Anwendungen und Technologien:

A Sintertechnik:

- Vakuum-Sinteranlage für metallische Sinterkörper für Dieselabgasfilter (Automobiltechnik);
- Vakuum-Sinteranlage zur Herstellung von schmierfreien Sinterlagerwerkstoffen auf Graphitbasis, für den Einsatz u.a. in der Luft- und Raumfahrt und bei der Erzeugung alternativer Energien (Windkraftanlagen) in der Fügetechnik;
- Hochvakuum-Lötanlage für die Herstellung von Hochleistungsvakuum-schaltkammern mit Integration der Anlagensteuerung in ein Gesamtproduktionssteuerungsnetzwerk.

B Werkstoffentwicklung und Herstellung:

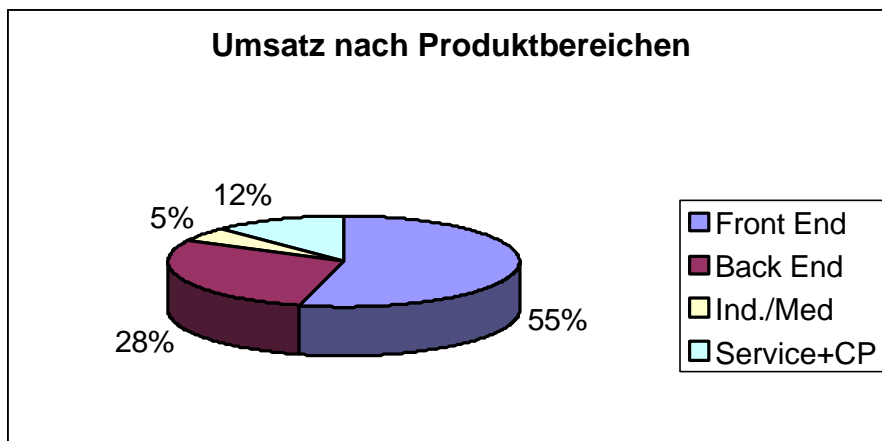
- Vakuu-Schmelzanlage für die Materialforschung und -entwicklung und Prozessentwicklung an einem in der Werkstofftechnologie führenden Hochschulinstitut;
- Hochtemperatur-Hochvakuumanlage zur Behandlung von Wolframanoden für Xenon-Scheinwerfer (Automobiltechnik);
- Wasserstoff-Wärmebehandlungsanlage für Metallpulver für die Herstellung von 12V-Hochleistungskondensatoren zum Einsatz in der Fahrzeugtechnik;
- Labor-Vakuumanlage für die Prozessentwicklung zur Herstellung von Brennelementen für Kugelhaufenreaktoren;
- Hochtemperatur-Vakuumanlage mit Nutzraum größer 2m³ und Betriebstemperatur von 2200°C zum Wärmebehandeln von Graphitwerkstoffen für die Halbleiterindustrie.

C Eintritt in neue Märkte und Zugewinn von Marktanteilen

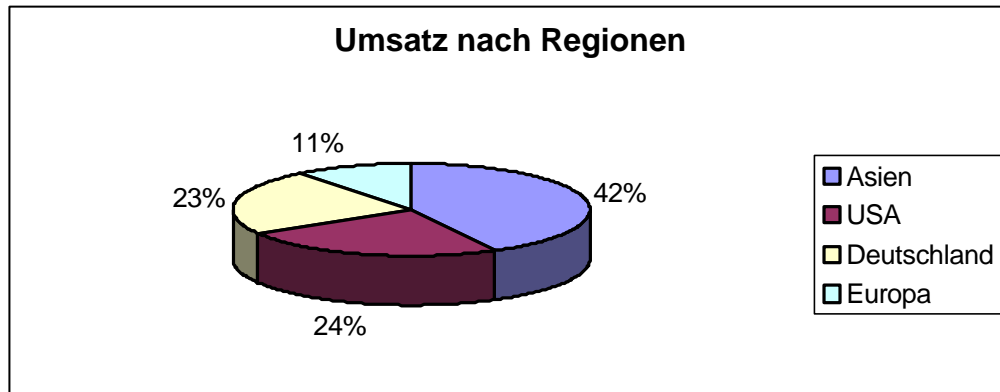
- Zwei Vakuu-Sinteranlagen für MIM-Teile in der Uhren- und Automobilzulieferindustrie.

Geschäftsbereich Plasma-Anlagen:

Der Gesamtumsatz mit Plasma-Anlagen erreichte im Geschäftsjahr 2003 8,3 Mio. € und lag damit um 5% über dem Vorjahresniveau (7,9 Mio. €). Der umsatzstärkste Produktbereich Front End verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr (4,1 Mio. €) mit Erlösen von 4,5 Mio. € um 10%. Maßgeblichen Anteil daran hatte ein Großauftrag aus den USA. Die Umsätze des Produktbereichs Back End bewegten sich mit 2,4 Mio. € nur geringfügig über dem Vorjahresniveau (2,3 Mio. €). Der Produktbereich Industrial/Medical lieferte mit 0,5 Mio. € (VJ 0,5 Mio. €) einen ebenfalls konstanten Umsatzanteil. Service und Contract Processing trugen mit einem zum Vorjahr (1,0 Mio. €) unveränderten Gesamtumsatz von 1,0 Mio. € bei.



Der Wachstumsmarkt Asien war trotz der SARS-Krise auch 2003 mit 3,5 Mio. € Umsatz die wichtigste Absatzregion für den GB Plasma-Anlagen. In absoluten Zahlen bedeutete dies dennoch einen Rückgang gegenüber 2002 (3,9 Mio. €) um rund 11%. In den USA konnte mit Erlösen von 2,0 Mio. € die rückläufige Entwicklung der Vorjahre (VJ 0,6 Mio. €) gestoppt werden. In Deutschland gelang es, den Umsatz mit 1,9 Mio. € (VJ 1,9 Mio. €) zu stabilisieren, während das Geschäft in Europa mit Erlösen von 0,9 Mio. € (VJ 1,5 Mio. €) rückläufig war.



5. Auftragslage

Die PVA TePla konnte im Berichtsjahr Bestellungen im Gesamtvolumen von rund 28,4 Mio. € (VJ 24,4 Mio. €) verbuchen. Der Auftragseingang blieb damit trotz der Steigerung um 16,4% gegenüber dem Vorjahr noch deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Geschäftsbereich Vakuum-Anlagen:

Im Umfeld der allgemein weiter schwachen Konjunktur und Investitionszurückhaltung konnte sich PVA TePla vergleichsweise gut im Markt behaupten. Der Auftragseingang ist im Berichtsjahr mit rund 19 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (17 Mio. €) um rd. 12% gestiegen. 6,3 Mio. € (33,4%) des Auftragseingangs kamen aus dem Inland und 12,6 Mio. € (66,6%) aus dem Ausland (VJ 54,4%). Zwei Drittel der Exporte bzw. rd. 44% des Gesamtauftragseingangs kamen aus dem asiatischen Markt, mehr als die Hälfte davon allein aus China. Der Auftragseingang lag damit im Berichtsjahr jedoch rund 36% unter den Erwartungen, was im Wesentlichen (mit 26%) auf den unerwarteten Ausfall des in Abschnitt 4. genannten Projektes für die Herstellung mineralischer Kristalle für die Mikrolithographie zurückzuführen ist.

Der Auftragseingang für Anlagen in Höhe von 15 Mio. € (VJ 12,3 Mio. €) verteilte sich wie folgt:

auf Branchen:	Hartmetall/Werkzeuge	€ 9,1 Mio.	60,6%
	Elektro-/Elektronik	€ 1,0 Mio.	6,9%
	Werkstofftechnik	€ 3,7 Mio.	24,6%
	Sonstige	€ 1,2 Mio.	8,0%
auf Produktreihen:	COD	€ 7,3 Mio.	48,5%
	COV	€ 3,2 Mio.	21,5%
	MOV	€ 2,9 Mio.	19,4%
	VSG	€ 0,6 Mio.	4,0%
	MIM	€ 1,0 Mio.	6,7%

Der Auftragseingang für Service betrug 3,9 Mio. €, entsprechend 20,7% des Gesamtauftragseingangs (VJ 4,7 Mio. € bzw. 28%).

Entgegen anderen Branchen investiert die Hartmetall-Branche vor allem in Asien (Korea/China) nicht nur in neue Technologien sondern auch weiter in Kapazitätsausweitung, so dass dieser Bereich wieder den größten Anteil am Gesamtauftragseingang darstellte. Mit Aufträgen von Neukunden in Europa und für den Umbau von Wettbewerbsanlagen konnten weitere Marktanteile in dieser Branche gewonnen und die Marktführerschaft ausgebaut werden.

Die Elektro-/Elektronikbranche, die im Wesentlichen Hochtemperaturanlagen der Baureihe MOV einsetzt, hatte mit rund 7 % wie im Vorjahr wiederum nur einen ungewöhnlich kleinen Anteil am Bestelleingang. Hier sowie in den Branchen der Werkstoffherstellung blieben Neuinvestitionen im Wesentlichen auf innovative Technologien beschränkt.

Mit einer Vakuumanlage der Baureihe MOV zur Behandlung von stranggepressten Sinterteilen konnte ein Neukunde im Bereich der Hartmetallwerkzeuge gewonnen werden. Insgesamt erreichte die MOV-Reihe mit drei weiteren Aufträgen für die Wärmebehandlung von speziellen Refraktärmetallen für neue Kondensatorwerkstoffe einen Anteil von rd. 20 % am Gesamtauftragsvolumen, was damit deutlich über dem des Vorjahres (8,5%) lag.

Der Bestelleingang für graphitbeheizte Vakuumanlagen sorgte mit 21,5 % für eine recht ausgeglichene Verteilung des Auftragsvolumens auf die Produktreihen. Auch hier liegen die Einsatzgebiete überwiegend in der Herstellung von Sonderwerkstoffen, wie das Sintern von Metallkörpern für Dieselabgasfilter, Werkstoffe für optische Schichten, Graphite für die Halbleiterindustrie oder hochreine Refraktärmetalle.

Mit dem Erhalt von zwei Aufträgen über Vakuumschmelz- und Gießanlagen für Edelmetalle in der Uhren- und Schmuckindustrie und eines Auftrages für eine auf Materialforschung für die Werkstoffentwicklung an einer technischen Hochschule optimierte ausgelegte Produktionsanlage konnte die Baureihe VSG eine solide Marktposition in diesen Nischenbereichen behaupten.

Mit zwei Aufträgen auf dem neuen Anwendungsgebiet der MIM-Technologie konnte dieser Bereich auf einen Auftragsanteil von rd. 7% ausgebaut werden. Es handelt sich hier um Vakuum-Hochtemperaturanlagen zum Entbindern von Spritzteilen und zum anschließenden Sintern für die Automobil- und Feinwerktechnik. Diese Aufträge werden im Unterauftrag von unserem US-amerikanischen Tochterunternehmen PVA MIMtech, LLC ausgeführt.

Das Angebotsvolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 20% auf ca. 60 Mio. € (VJ 48 Mio. €) und resultierte in einem Auftragseingang für Anlagen in Höhe von ca 15 Mio. € (VJ 12 Mio. €).

Der Auftragsbestand des Geschäftsbereichs lag zum Berichtsjahresende mit rd. 12 Mio. € deutlich über dem Vorjahreswert (10 Mio. €).

Zur strategischen Technologie- und Geschäftsentwicklung wurde der Vertrieb für Vakuum-Anlagen im Berichtsjahr um eine Task-Force für die Identifikation von und den Einstieg in neue Anwendungsfelder, z.B. bei neuen Technologien (neue Materialien und Herstellungsverfahren), verstärkt.

Geschäftsbereich Plasma-Anlagen:

Der Auftragseingang des GB Plasma-Anlagen betrug in 2003 rund 9,5 Mio. € und lag dabei mehr als 28% über dem Vorjahreswert (7,4 Mio. €).

Der Auftragseingang teilte sich auf wie folgt:

	<u>2003</u>	<u>Vorjahr</u>
Front End Semiconductor	€ 5,3 Mio.	€ 3,3 Mio.
Back End Semiconductor	€ 2,8 Mio.	€ 2,5 Mio.
Industrial / Medical	€ 0,4 Mio.	€ 0,6 Mio.
Service	€ 1,0 Mio.	€ 1,0 Mio.

Die Region Asien hatte mit 4,9 Mio. € (51,5%) den wichtigsten Anteil am Auftragseingang. Am deutlichsten war der Rückgang in Europa mit nur noch 0,8 Mio. € (8,4%) ausgeprägt. In den USA führte ein Großauftrag aus der Automobilindustrie bei Aufträgen von 2,0 Mio. € (21,0%) zu einem wieder steigenden Anteil. Die Geschäftsentwicklung in Deutschland blieb mit Aufträgen von 1,8 Mio. € (18,9%) auf niedrigem Niveau. Das Kundenspektrum hat sich schwerpunktmäßig von Fab-Kunden klar zu Firmen aus dem Segment der MEMS (Mikro Electro Mechanical System)- Fertigung verschoben. Dieser Trend dürfte sich auch in 2004 fortsetzen, da weltweit viele Neugründungen von Unternehmen in Sensorik, Mikromechanik und Photonik zu verzeichnen sind und der Markt für MEMS-Bauelemente sich zu entwickeln beginnt. Auffällig war das Anziehen der Aufträge aus der Flat Panel Industrie.

Der Geschäftsbereich konnte an die Tendenz einer zum Jahresende über dem Faktor 1 liegenden Book-to-Bill Ratio der Branche anknüpfen.

Aufgrund der kurzen Auftragsdurchlaufzeiten bei Plasma-Anlagen wurden die Aufträge größtenteils noch im Berichtsjahr umsatzrelevant.

Der Auftragsbestand des Geschäftsbereichs lag zum Berichtsjahresende bei 2,3 Mio. € (VJ 1,1 Mio. €).

6. Beschaffung, Produktion

Die Produktion der Systeme und Anlagen erfolgte im Berichtsjahr an den Standorten Aßlar und Feldkirchen.

Trotz im Jahresmittel mit ca. 85% nicht erreichter Vollauslastung am Standort Aßlar konnte dort der Bereich Produktion aufgrund schwankender Auslastung im Jahresverlauf den Kapazitätsbedarf der Fertigung nicht voll abdecken. Zum Ausgleich von Auslastungsspitzen wurden periodenspezifisch Fremdleistungen mit Werkverträgen und Arbeitnehmerüberlassung in Höhe von knapp 0,4 Mio. € (VJ ca. 0,3 Mio. €) zugekauft. Entsprechend der bisherigen Praxis wurde die Fertigungstiefe für nicht Technologie tragende Teile bis hin zu kompletten Baugruppen mit Montageleistungen weiter auf niedrigem Niveau gehalten. Dies führt zwar zu einem höheren prozentualen Wareneinsatz, andererseits aber jedoch zu flexibleren Anpassungsmöglichkeiten an Auslastungsschwankungen.

Am Standort Feldkirchen betrug die Kapazitätsauslastung im Jahresdurchschnitt 79%.

Die im Vorjahr in Kahla produzierten Metrology Systeme wurden nach der Schließung dieses Standorts im Unterauftrag bei einer Tochtergesellschaft in Jena gefertigt. Die Fertigungstiefe für nicht Technologie tragende Teile bis hin zu kompletten Baugruppen mit Montageleistungen wurde weiter niedrig gehalten.

7. Forschung & Entwicklung

Geschäftsbereich Vakuum-Anlagen:

Im Berichtsjahr wurden wiederum alle Weiterentwicklungen und Optimierungen der Vakuumanlagen- und -prozesstechnik im Rahmen der Auftragsabwicklung mit und für Kunden entsprechend den Anforderungen in den Einzelprojekten durchgeführt.

Für einen breiten Anwendungsbereich in der Werkstoffforschung und -entwicklung an einem Hochschulinstitut wurden für eine Vakuumschmelz- und Gießanlage VSG 100 DS

spezielle Zusatzausrüstungen, wie u.a. ein beheizter Gießtrichter, ein Kokillenrevolver mit Kokillenkühlung, eine Einrichtung zur Flakeherstellung sowie eine Langspule mit Tiegelabsenkeinrichtung für die Simulation von Strangguss unter Vakuum konzipiert und geliefert.

Ebenfalls für die Herstellung neuer Werkstoffe, die in der Automobilindustrie breiten Einsatz finden sollen, wurde eine metallisch beheizte Schutzgas-Anlage zur Behandlung von Refraktärmetallpulvern unter gerichtet strömendem Wasserstoff bei leichtem Überdruck und einer Betriebstemperatur von 1600°C entwickelt und beim Kunden in Betrieb genommen.

Für die Hochtemperatur-Wärmebehandlung wurde eine Heizerstromzuführung für höchste Strombelastung entwickelt und für den Produktionsbetrieb in einer großvolumigen Hochtemperatur-Glühanlage der Baureihe COV erprobt.

Für Dieselabgasfilter wurde eine COV-Anlage mit universeller, sehr flexibler Ausrüstung und entsprechenden Funktionen für die Sinter-Prozessentwicklung von neuen Werkstoffen entwickelt. Nach einer Qualifizierung des Herstellungsverfahrens ist ein hoher Bedarf an Produktionsanlagen für dieses Einsatzgebiet zu erwarten.

Ebenfalls zur Erprobung und Entwicklung einer neuen Verfahrenstechnologie bei der Herstellung von Refraktärmetall-Pulvern wurde in Zusammenarbeit mit einem Kunden eine Pilotanlage entwickelt, die die kontrollierte Abdampfung und gezielte lokale Kondensation von prozessbedingten Metaldämpfen ermöglicht, wobei auch hier nachfolgend potentiell ein Produktionskapazitätsbedarf zu sehen ist.

Im Rahmen eines Auftrages von einem chinesischen Forschungsinstitut wurde eine MOV-Heißpresse für erheblich höhere Presskräfte (bis 100 t) und spezielle Presswerkzeuge für eine wesentlich vergrößerte Pressfläche zur Krafterleitung und gleichmäßigen Kräfteverteilung entwickelt.

Im GB Vakuum-Anlagen erfolgen F&E-Arbeiten grundsätzlich im Rahmen von Kundenaufträgen; sie werden daher nicht gesondert ausgewiesen. Die darin enthaltenen Leistungen, die zu generell wiederverwendbaren Verbesserungen bzw. Neuerungen des Produktprogramms führen, können mit bis zu 50% unserer gesamten Konstruktionsleistung veranschlagt werden.

Geschäftsbereich Plasma-Anlagen:

Dem GB Plasma-Anlagen gelang es, die F&E Aufwendungen des Vorjahres (1,5 Mio. €) weiter auf 1,1 Mio. € zu optimieren. Dabei konzentrierte sich der Geschäftsbereich hauptsächlich darauf, begonnene Produktentwicklungen zur Marktreife zu bringen und erfolgreich eingeführte Systeme weiter zu optimieren. Bei den Produktentwicklungen standen verschiedene Anwendungen in der Flachbildschirmfertigung im Vordergrund.

Beim Hauptumsatzträger, der Serie 300/600 Plasma Asher für das Fotolackstrippen, wurde die Steuerungssoftware weiter entwickelt und damit die Zuverlässigkeit der Anlagen erhöht. Diese Verbesserungen waren auch für einen Großauftrag aus USA von besonderer Bedeutung und sollten sich positiv auf die zukünftigen Servicekosten auswirken.

Eine Performanceverbesserung der Plasmaquelle wurde mit einer CE-Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen.

Das Plasmasystem 800, eine hochproduktive Maschine für das Veraschen von Fotolack auf 200 mm Wafern, ist in 2003 zur Serienreife gelangt. Dabei gelang es, die Ätzrate durch eine Optimierung der Prozesssoftware zu verdoppeln.

Bei den Flat Panel Systemen wurde das System 4011, das Einstiegsmodell in der OLED-Fertigung, für neuartige Prozesse in der digitalen Röntgenbildaufzeichnung und der Fertigung von EL-Displays im Kundenauftrag weiterentwickelt.

Das System QuarzClean, eine Anlage zur schonenden Reinigung von Wafer-Booten aus Quarz (Gestelle für die Aufnahme von bis zu 75 Wafer) wurde erstmals in der Fertigung eines Schlüsselkunden übernommen, nachdem es gelungen war, die Lebensdauer der teuren Quarzboote durch die Plasmabehandlung nochmals zu verlängern.

Bei dem in der Solarzellenfertigung eingesetzten System 400 Solar wurde die Entwicklung eines Programms zur Erhöhung der Ätzrate gestartet, das Anfang 2004 abgeschlossen werden soll.

Im Bereich der Chip Packaging Systeme lag der Schwerpunkt der Entwicklung bei dem Plasmasystem 80, das speziell für die Inline Fertigung und die Behandlung von Einzelsubstraten für das Drahtbonden und das Verkapseln der Chips konzipiert wurde. Nachdem die ersten Kundenevaluierungen erfolgreich verlaufen sind, wird sich die weitere Entwicklung auf die Integration des Systems in vollautomatische Fertigungslinien konzentrieren.

Beim System 400 wurde die Software zur Vorbereitung auf zukünftige Chip Packaging Prozesse optimiert. Eine neue Variante dieses Systems mit Drehtrommel wurde im Kundenauftrag für die Bearbeitung von industriellem Schüttgut entwickelt.

Bei dem atmosphärischen Plasmasystem PlasmaPen brachte der Einsatz eines neuartigen Schaltnetzteils eine Vervierfachung der Bearbeitungsgeschwindigkeit.

8. Investitionen

Bei den im Anlagespiegel ausgewiesenen Zugängen in 2003 zum Anlagevermögen von rund 170 T € handelt es sich im Wesentlichen um Investitionen in Betriebs und Geschäftsausstattung (66%) und immaterielle Vermögensgegenstände (24%).

Rund 55% der Gesamtinvestitionen wurden im GB Vakuum-Anlagen am Standort Aßlar getätigt; u.a. in Software zur Komplettierung des in 2002 neu eingeführten PPS-Systems.

Die restlichen 45% wurden im GB Plasma-Anlagen am Standort Feldkirchen investiert.

Investitionen in Finanzanlagen wurden im Berichtsjahr nicht getätigt. Die im April 2003 ergangene Insolvenzeröffnung über das Vermögen der 100%-igen Tochtergesellschaft Vakuum-Anlagen Service GmbH hatte in 2003 keine Auswirkungen auf die Finanzanlagen, da die Beteiligung bereits im Vorjahr auf Null abgeschrieben worden war.

Die Finanzanlagen umfassten in 2003 unverändert die PVA Control GmbH, PVA Löt- und Werkstofftechnik GmbH, UV Systec Gesellschaft für UV-Strahler und Systemtechnik mbH (mit PVA Vakuum-Anlagenbau Jena GmbH), die TePla France SAS (Frankreich), die TePla America, Inc. und die PVA USA Corp. (beide USA; mit PVA MIMtech, LLC) sowie die Crystal Growing Systems GmbH.

Für das Geschäftsjahr 2004 sind abgesehen von dem bereits erwähnten Erwerb weiterer 25% Anteile an der PVA MIMtech LLC, Cedar Grove, NJ/USA, der mit Wirkung zum 1. Januar 2004 durch Ausübung einer Call Option in 2003 erfolgte, keine weiteren nennenswerten Neuinvestitionen geplant.

9. Vermögens- und Finanzlage

Zum Jahresende 2003 weist die PVA TePla ein Umlaufvermögen in Höhe von 15,8 Mio. € (VJ 16,9 Mio. €) aus. 7,6 Mio. € (VJ 8,1 Mio. €) entfallen auf Vorräte und 7,0 Mio. € (VJ 8,5 Mio. €) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände. Der Rückgang der Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultiert aus zum Bilanzstichtag geringeren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Das Anlagevermögen in Höhe von 14,7 Mio. € verringerte sich nur unwesentlich (um 5%) gegenüber dem Vorjahr (15,5 Mio. €). Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht getätigt.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten lagen mit 5,5 Mio. € bz w. 9,7 Mio. € auf Vorjahresniveau. Die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 1,2 Mio. € betrifft ein von der Crystal Growing Systems GmbH gewährtes Darlehen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beliefen sich auf 3,7 Mio. € (VJ 3,4 Mio. €). Dem stehen Guthaben in Höhe von 1,1 Mio. € (VJ 0,3 Mio. €) gegenüber, so dass sich zum Bilanzstichtag eine Nettofinanzposition von -2,5 Mio. € (VJ -3,1 Mio. €) ergibt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das oben genannte Darlehen der Crystal Growing Systems GmbH (1,2 Mio. €) wesentlich zur Reduzierung der Nettosition beitrug. Die von den Banken bis auf weiteres zugesagten Kreditlinien bieten aus heutiger Sicht genügend Finanzierungsspielraum zur Abwicklung des geplanten Geschäfts.

Zum Ende des Berichtsjahres verfügt die PVA TePla AG bei einem Gezeichneten Kapital von 21,45 Mio. € über ein Eigenkapital von 15,3 Mio. € (VJ 17,3 Mio. €). Bei einer ausgewiesenen Bilanzsumme von 30,5 Mio. € entspricht dies einer Eigenkapitalquote von 50%.

10. Ertragslage

Infolge der noch nicht wieder erhaltenen Weltwirtschaftslage, der Investitionszurückhaltung der Kunden und des den Absatz erschwerenden starken Euro haben sich die Umsatzerlöse - anders als erwartet - nur moderat von 25,4 Mio. € auf 26,3 Mio. € erhöht. Zum Bruttoergebnis in Höhe von 6,6 Mio. € (VJ 2,1 Mio. €) tragen der GB Vakuum-Anlagen mit rund 2,8 Mio. € (VJ 2,2 Mio. €) und der GB Plasma-Anlagen mit 3,8 Mio. € (VJ -0,1 Mio. €) bei. Das Vorjahresbruttoergebnis des GB Plasma-Anlagen war durch Aufwendungen für Restrukturierung mit 1,4 Mio. € belastet. Darüber hinaus wurden in den Umsatzkosten des Vorjahres Vertriebsprovisionen in Höhe von 0,6 Mio. € ausgewiesen, die im Berichtsjahr den Vertriebsaufwendungen zugeordnet werden. Ohne Berücksichtigung dieser Effekte resultiert die Erhöhung der Bruttomarge im Wesentlichen aus der Umsatzsteigerung sowie geringeren Umsatzkosten, in denen sich die im Vorjahr eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen niedergeschlagen haben. Die Erhöhung der Bruttomarge im GB Vakuum-Anlagen ergibt sich im Wesentlichen aus der Umsatzsteigerung.

Unter Berücksichtigung der oben angesprochenen Ausweisänderung haben sich die Vertriebskosten von 4,7 Mio. € im Vorjahr u.a. aufgrund der im Vorjahr durchgeführten Personalanpassung sowie geringerer Vertriebsprovisionen auf 4,3 Mio. € vermindert.

Die Reduzierung der allgemeinen Verwaltungskosten um 1,1 Mio. € ergibt sich im Wesentlichen aus im Vorjahr in dieser Position ausgewiesenen Aufwendungen von insgesamt 0,9 Mio. € für die Verschmelzung und Personalanpassungsmaßnahmen.

Im Rückgang der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen hat sich die oben erwähnte Straffung der entsprechenden Prozesse niedergeschlagen.

Die Abnahme der sonstigen betriebliche Erträgen um 0,3 Mio. € resultiert insbesondere aus höheren Auflösungen von Garantierückstellungen im Vorjahr.

Insbesondere aufgrund der Zuführung zur Rückstellung für Mietdrohverluste haben sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. € erhöht.

Während im Vorjahr Erträge aus der Beteiligung an der Crystal Growing Systems GmbH in Höhe von 0,8 Mio. € vereinnahmt wurden, waren im Berichtsjahr keine Ausschüttungen zu verzeichnen.

Die Zinsaufwendungen haben sich im Berichtsjahr aufgrund deutlich günstigerer Konditionen erheblich um 0,2 Mio. € reduziert. Dies resultiert aus den wesentlich günstigeren Refinanzierungsmöglichkeiten der durch Verschmelzung neu entstandenen Gesellschaft gegenüber der ursprünglichen TePla (GB Plasma-Anlagen).

Nach Eliminierung der Sondereinflüsse (Kosten der Verschmelzung 0,6 Mio. €, Restrukturierungsaufwendungen 2,0 Mio. €, außerplanmäßige Abschreibungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen 3,7 Mio. €) ergab sich im Vorjahr ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von -4,1 Mio. €. Das vergleichbare Ergebnis des laufenden Jahres beträgt -1,7 Mio. €. Dieser Verlust ist auf die im Verhältnis zum unterplanmäßigen Umsatz noch zu hohen Aufwendungen zurückzuführen. Allerdings zeigt die Verbesserung des Ergebnisses die ersten Einsparungserfolge der ab Ende 2002 begonnenen Restrukturierung.

Das Berichtsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 2,0 Mio. € ab. Der Verlust des Vorjahres (19,7 Mio. €) beinhaltet neben dem Verlust aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen Verschmelzungsverlust in Höhe von 9,3 Mio. €, ohne den der Vorjahresfehlbetrag bei 10,4 Mio. € gelegen hätte.

11. Personalentwicklung / Organveränderungen

Am 31. Dezember 2003 beschäftigte die PVA TePla 153 Mitarbeiter. Der deutliche Rückgang gegenüber dem Vorjahr (191 Mitarbeiter) resultiert aus der Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen. Der GB Vakuum-Anlagen verzeichnete für sich genommen einen Rückgang der Mitarbeiterzahl von 128 auf 108 Mitarbeiter am Jahresende 2003; die Mitarbeiterzahl im GB Plasma-Anlagen sank von 63 auf 45.

Die PVA TePla kommt trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung durch die Ausbildung junger Menschen nach. In 2003 beschäftigte der GB Vakuum-Anlagen 5 Auszubildende sowie mehrere Praktikanten, vornehmlich in technischen Bereichen.

Mit Ablauf des 14. Januar 2003 ist Herr Friedrich G. Meyer aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden. Zuletzt Bereichsvorstand für Plasma-Anlagen, hat er seine Aufgaben an den Vorstandskollegen Martin Gier übergeben, der damit im Konzern die GB's Kristallzucht-Anlagen und Plasma-Anlagen führt. Der Aufsichtsrat hat mit Wirkung ab dem 16. April 2003 Frau Nina von Wersebe als Finanzvorstand bestellt, nachdem Herr Craig Walker am 11. April 2003 als Vorstand abberufen worden war.

Im Laufe des Geschäftsjahres wurde durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Juni 2003 Herr Bernhard Zeller als Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Herr Wolfgang Dondorf hatte zuvor sein Aufsichtsratsmandat zum Ende dieser ordentlichen Hauptversammlung niedergelegt.

12. Risiken

Die PVA TePla ist als weltweit operierendes Technologieunternehmen einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt, die untrennbar mit dem unternehmerischen Handeln aller Geschäftsbereiche verbunden sind.

Das wirtschaftliche Umfeld der Gesellschaft ist geprägt durch globale Märkte und die ständig wachsende Komplexität der technologischen Anwendungen. Die Risiken einer existenzbedrohenden Firmen- und Umfeldentwicklung werden vom Management des Unternehmens laufend beobachtet und evaluiert und - soweit angezeigt und möglich - reduziert oder ausgeglichen. Die Beurteilung der Risikofaktoren fließt in die unternehmerischen Entscheidungen ein.

Das primäre Ziel eines effizienten und vorausschauenden Risikomanagements ist das Identifizieren von Risiken. Hierzu steht den Geschäftsbereichen und Mitarbeitern ein Risikomanagement-Handbuch mit Verfahrensanleitungen, einem Maßnahmenkatalog aber auch internen Führungsprozessen zur Verfügung, wodurch die geschäftlichen Risiken transparent und reduziert werden. Im kaufmännischen Bereich wird diese Aufgabe durch das Vier-Augen-Prinzip gewährleistet.

Die Marktrisiken liegen besonders in unerwarteten Schwankungen der Investitionstätigkeit der Kunden bzw. Branchen. Dieses Risiko wird durch Diversifizierung des Leistungsangebotes in verschiedene Branchen wie Chip-Produktion, Werkzeug- und Hartmetall, Herstellung hochwertiger Metalle und Keramiken, Automobil- und Flugzeug-Industrie, Elektro- und Elektronikindustrie reduziert. Zyklische, absehbare Schwankungen des Marktvolumens werden vornehmlich durch Zukauf oder Reduzierung von Fremdleistungen ausgeglichen. Auch werden in der PVA TePla-Gruppe hochwertige Lohnarbeiten - wie Plasma-Behandlung oder Hochvakuum-Löten und -Wärmebehandeln von Bauteilen - angeboten, die erfahrungsgemäß in Zeiten geringer Investitionsneigung von den Kunden verstärkt nachgefragt werden.

Besonders das Halbleitergeschäft, eine wichtige Branche für die PVA TePla, ist gekennzeichnet durch eine hohe Zyklizität und bietet daher große Chancen und Risiken. Obwohl die Chip-Branche in den letzten Jahrzehnten eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate weit über den meisten Old-Economy-Branchen hatte, umfasst dieser Durchschnitt sowohl starke Wachstums- als auch Rezessionsjahre. Ergänzt wird diese Risikolage durch einen hohen Investitions- und Entwicklungsbedarf zur Absicherung der Marktstellung.

Das Risiko der Auftragsverluste durch eine unerwartete, neu am Markt auftauchende (Seiteneinsteiger-) Technologie wird durch ständige Beobachtung neuer branchenspezifischer Forschungs- und Technologiearbeiten und veröffentlichter Ergebnisse sowie Gespräche mit den Schlüsselkunden weltweit verfolgt und eingeschätzt.

Die hohe technische Komplexität der Produkte und der schnelle technologische Fortschritt beinhalten Risiken im Hinblick auf den Bereich Forschung und Entwicklung. Der mittel- und langfristige Erfolg hängt entscheidend davon ab, dass innerhalb angemessener Zeitspannen marktfähige Produkte entwickelt werden, die zeitnah ausreichende Umsätze generieren, so dass der Cash Flow die Innenfinanzierung des Unternehmens sichert.

Die Liquiditäts- und Kreditrisiken für die Finanzierung des Geschäftsbetriebes werden bei Großaufträgen durch Kunden- und Lieferantenfinanzierung gesenkt. Dabei wird meist eine mehrstufige Anzahlungsregelung, beginnend mit durchschnittlich 30% bei Auftragseingang, vertraglich vereinbart. Im Gegensatz dazu muss die Gesellschaft bei wenigen Lieferanten eine Anzahlung leisten. Darüber hinaus optimiert die Gesellschaft ihren externen Liquiditätsbedarf durch rollierende Liquiditätsvorschau der dem Konzern

angehörigen Unternehmen und kurzfristige Darlehensgewährungen innerhalb des Konzerns.

Die Gesellschaft verbucht einen Großteil ihrer Umsätze mit dem Ausland. Die Fakturierung der Aufträge auch außerhalb des EU-Raumes erfolgt überwiegend in Euro. Anderenfalls wird im Einzelfall die Absicherung von Währungsschwankungen durch Devisentermingeschäfte gewährleistet. Im Falle von an ausländische Tochtergesellschaften in Fremdwährung ausgereichten Darlehen ist eine Kurssicherung wegen des unbestimmten Rückzahlungstermins nicht möglich; dem Risiko wird hingegen durch entsprechende Höherverzinsung Rechnung getragen.

Das Personalkapazitätsrisiko liegt besonders bei der Rekrutierung und Integration von kompetentem Führungs- und Fachpersonal zur Substitution insbesondere altersbedingt ausscheidender Führungs- und Fachkräfte und zur Bewältigung von Wachstum und der Einführung neuer Technologien, soweit entsprechendes Personal nicht aus eigenen Reihen entwickelt werden kann. Es liegt zur Zeit aber auch bei der Verhinderung von Abwanderungsgedanken aufgrund der Restrukturierungsphase. Insgesamt gestaltet sich die Einstellung von hoch qualifiziertem Personal aufgrund der Verfügbarkeit am Markt eher schwierig, und dies im In- und Ausland. Es werden Kontakte zu verschiedenen Ausbildungsstätten/Hochschulen unterhalten und ausgebaut, um geeignetes Personal zu finden. Eine nennenswerte Personal-Fluktuation ist über die letzten Jahre gleichwohl nicht zu erkennen.

Alle Unternehmen, an denen der Konzern zu mehr als 50% beteiligt ist, sind im Rahmen ihrer Qualitätssicherung zertifiziert nach ISO 9001/2000. Die Aufrechterhaltung eines auf jedes Konzernunternehmen zugeschnittenen Qualitätssicherungssystems wird von einer zentralen Stelle unterstützt und überwacht. Auch der Abschluss geeigneter Versicherungen zur Abdeckung der verschiedenen Betriebsrisiken wird für die Konzernunternehmen von einer zentralen Stelle koordiniert.

Das Risiko des Ausfalls eigener Maschinen ist eher von untergeordneter Bedeutung, da wenige Werkzeugmaschinen im Einsatz (die Produktion hat den Schwerpunkt bei Montage- und Inbetriebnahme-Tätigkeiten) und auch ausreichend geeignete Maschinen bei nahen Unterlieferanten vorhanden sind. An den eigenen Plasma-Anlagen und Vakuum-Lötanlagen kann präventive Wartung und rascher Ausfallservice selbst durchgeführt werden.

Das Ausfallrisiko von EDV-Anlagen und die Bedrohung durch Softwareviren wird durch regelmäßige Datensicherung und durch Firewalls reduziert.

Das Ausfallrisiko von Lieferanten wird durch eine gezielte Auswahl und Qualifizierung alternativer Lieferanten, auch im Ausland, erheblich reduziert. Bei allen bedeutenden Zulieferern wird auf ein geeignetes Qualitätssicherungssystem und eine Haftungsdeckung durch Versicherungen geachtet.

Die letzte steuerliche Außenprüfung der PVA hat die Veranlagungszeiträume bis einschließlich 1999 berücksichtigt; bei der TePla hat die letzte steuerliche Außenprüfung die Veranlagungszeiträume bis einschließlich 1995 berücksichtigt. Die steuerliche Außenprüfung bei der TePla für die Veranlagungszeiträume 1997 bis 2000 ist im Gange. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die mit ihren Steuerberatern erstellten Steuererklärungen vollständig und korrekt abgegeben wurden. Wegen der Komplexität und unter Umständen unterschiedlicher Betrachtungsweisen von Sachverhalten sowie der Vielzahl ungeklärter Rechtsfragen kann derzeit aber weder der Ausgang der steuerlichen Außenprüfung beurteilt noch das wahrscheinliche Risiko einer möglichen Steuernachzahlung beziffert werden.

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können, sind nicht erkennbar.

13. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres lagen nicht vor.

14. Ausblick

Sowohl im Maschinen- und Anlagenbau als auch im Werkzeugmaschinenbau mehrten sich die Anzeichen einer zumindest moderaten wirtschaftlichen Erholung. Führende Institute erhöhten ihre Prognosen für 2004. So erwartet der VDMA in einer Mitte Februar veröffentlichten Studie für 2004 ein Wachstum von 2% im Maschinen- und Anlagebau. Der VDW erwartet für den Werkzeugmaschinenbau sogar einen Zuwachs von 4%. In beiden Branchen hat sich der Auftragseingang zum Jahresende deutlich belebt.

Der GB Vakuum-Anlagen sollte von dieser Tendenz profitieren und seine Weltmarktführerschaft für Hartmetall-Sinteranlagen in 2004 weiter ausbauen können. Die starke Stellung in Wachstumsmärkten wie China und der Ausbau der Vertriebsaktivitäten des GB Vakuum-Anlagen in den USA bieten weitere Chancen.

Die stark rezessiven Entwicklungen der Halbleiterindustrie seit dem Boomjahr 2000 konnten in 2003 gestoppt werden und führten zu einer Stabilisierung der weltweiten Nachfrage. Während die Chiphersteller in der zweiten Jahreshälfte 2003 bereits erste Erfolge erzielten, ist bei den Ausrüstern von Fertigungslinien für die Chip-Industrie mit einer wesentlichen Erholung im Laufe des Jahres 2004 zu rechnen. Das auf die Halbleiterindustrie fokussierte Institut VLSI Research Inc. sieht in einer Anfang Januar veröffentlichten Studie nunmehr einen markanten Wendepunkt erreicht und rechnet in den beiden nächsten Jahren wieder mit erheblichen Zuwachsraten für die Ausrüster. Auf eine deutliche Branchenerholung deutet auch das Book-to-Bill Ratio für Dezember 2003 hin, das laut einer Mitte Januar veröffentlichten Information des Branchenverbandes SEMI den hohen Wert von 1,2 erreichte.

Von diesem sich abzeichnenden Trend sollte der GB Plasma-Anlagen in 2004 profitieren, zumal in der Forschung und Entwicklung das Hauptaugenmerk auf die Vermarktungsfähigkeit der jeweiligen Produkte gelegt wurde.

In nahezu allen für die PVA TePla relevanten Absatzmärkten und auch in der allgemeinen Konjunktur zeichnet sich in 2004 eine spürbare Erholung ab. Der zu den wichtigsten Weltwährungen und insbesondere dem US Dollar weiterhin starke Euro stellt allerdings eine große Herausforderung für die zu einem hohen Maß exportabhängige PVA TePla dar.

Da wesentliche Kostenstrukturen der Gesellschaft bereits an die Geschäftsentwicklung angepasst wurden, erwartet die Gesellschaft – eine weiterhin fortschreitende Konjunkturerholung und eine Stabilisierung des Euro auf weltwirtschaftlich verträglichem Niveau vorausgesetzt - für 2004 die Rückkehr in die operative Gewinnzone.

Aßlar, 16. März 2004

Der Vorstand

Peter Abel

Martin Gier

Volker Lang

Nina von Wesebe

PVA TePla AG, Ablar (i. Vj. Feldkirchen)
Bilanz zum 31. Dezember 2003

AKTIVA

	31.12.03	31.12.2002
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	576.645,03	747.180,52
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.049.278,84	1.124.724,84
2. Technische Anlagen und Maschinen	341.500,85	486.562,85
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>702.184,63</u>	<u>1.121.471,44</u>
	2.092.964,32	2.732.759,13
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>11.999.827,84</u>	<u>11.999.827,84</u>
	<u>14.669.437,19</u>	<u>15.479.767,49</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.045.458,26	2.377.760,05
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.431.229,58	3.506.816,89
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	773.548,77	1.809.051,94
4. Geleistete Anzahlungen	<u>380.616,23</u>	<u>401.409,64</u>
	7.630.852,84	<u>8.095.038,52</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.122.902,91	3.039.381,95
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.390.226,14	5.006.208,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>485.479,26</u>	<u>495.895,99</u>
	6.998.608,31	<u>8.541.486,56</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	<u>1.142.054,90</u>	<u>311.427,97</u>
	<u>15.771.516,05</u>	<u>16.947.953,05</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>21.915,49</u>	<u>43.949,19</u>
	<u>30.462.868,73</u>	<u>32.471.669,73</u>

PASSIVA

	31.12.03		31.12.2002
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	21.449.988,00		21.449.988,00
II. Kapitalrücklage	17.735.274,63		17.735.274,63
III. Gewinnrücklage	613.550,26		613.550,26
IV. Bilanzverlust	<u>-24.525.998,03</u>		<u>-22.537.864,68</u>
		15.272.814,86	17.260.948,21
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.985.535,00		2.498.327,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.512.718,38</u>		<u>3.047.811,99</u>
		5.498.253,38	5.546.138,99
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.663.466,29 (Vorjahr EUR 3.401.650,66) -	3.663.466,29		3.401.650,66
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.233.242,35 (Vorjahr EUR 3.001.635,30) -	2.233.242,35		3.001.635,30
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 858.654,06 (Vorjahr EUR 1.365.545,31) -	858.654,06		1.365.545,31
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.062.480,41 (Vorjahr EUR 877.056,43) -	2.062.480,41		877.056,43
5. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 870.224,07 (Vorjahr EUR 1.011.228,41) - - davon aus Steuern EUR 266.212,09 (Vorjahr EUR 155.188,14) - - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 205.278,26 (Vorjahr EUR 227.501,70) -	870.224,07		1.011.228,41
		9.688.067,18	9.657.116,11
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>3.733,31</u>	<u>7.466,42</u>
		<u>30.462.868,73</u>	<u>32.471.669,73</u>

PVA TePla AG, Aßlar (i. Vj. Feldkirchen)**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003**

	2003 EUR	2002 EUR
1. Umsatzerlöse	26.337.000,03	25.440.176,04
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	<u>-19.713.422,02</u>	<u>-23.300.867,93</u>
3. Bruttoergebnis vom Umsatz	6.623.578,01	2.139.308,11
4. Vertriebskosten	-4.349.750,21	-4.142.670,55
5. allgemeine Verwaltungskosten	-3.552.367,91	-4.600.655,19
6. Forschungs- und Entwicklungskosten	-1.064.014,62	-1.523.128,15
7. sonstige betriebliche Erträge	1.518.589,53	1.866.452,23
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.265.113,78	-996.961,14
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	837.303,13
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 837.303,13) -		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	180.954,19	115.953,64
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 171.862,50 (Vorjahr EUR 61.134,26) -		
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	-3.688.900,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-212.001,50	-391.314,89
- davon an verbundene Unternehmen EUR 45.569,45 (Vorjahr EUR 0,00) -		
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-2.120.126,29</u>	<u>-10.384.612,81</u>
14. Verschmelzungsverlust	<u>0,00</u>	<u>-9.266.687,66</u>
15. Außerordentliches Ergebnis	0,00	-9.266.687,66
16. Ertrag aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Vorjahr Steuern vom Einkommen und vom Ertrag)	139.617,00	-27.532,61
17. sonstige Steuern	<u>-7.624,06</u>	<u>-12.646,90</u>
18. Jahresfehlbetrag	-1.988.133,35	-19.691.479,98
19. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>-22.537.864,68</u>	<u>-2.846.384,70</u>
20. Bilanzverlust	<u><u>-24.525.998,03</u></u>	<u><u>-22.537.864,68</u></u>

A N H A N G

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2003
der

PVA TePla AG

Allgemeine Angaben und Erläuterungen

1. Allgemeine Angaben

Die PVA TePla AG (PVA TePla) ist in 2002 durch Zusammenschluss der beiden selbständigen Gesellschaften PVA Vakuum-Anlagenbau GmbH (PVA), Aßlar, und TePla AG (TePla), Feldkirchen, entstanden; der Sitz der Gesellschaft wurde am 18. August 2003 von Feldkirchen nach Aßlar verlegt.

Mit zivilrechtlicher Wirkung zum 5. November 2002 wurden die PVA und die TePla verschmolzen. Die Firma lautet seither „PVA TePla AG“. Die Verschmelzung erfolgte durch Übertragung des Vermögens der PVA (übertragende Gesellschaft) als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung auf die TePla (übernehmende Gesellschaft) gegen Gewährung von Aktien der TePla an die Anteilseigner der PVA. Die Übernahme des Vermögens der PVA durch die TePla erfolgte im Innenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2001. Vom 1. Januar 2002 an galten alle Handlungen und Geschäfte der PVA als für Rechnung der TePla vorgenommen („Verschmelzungstichtag“).

Der tatsächliche Übergang des Vermögens einschließlich der Verbindlichkeiten der übertragenden PVA auf die TePla fand zum Zeitpunkt der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der TePla am 5. November 2002 statt.

Das übergegangene Vermögen wurde in Ausübung des Wahlrechts nach § 24 UmwG zu den Buchwerten des übertragenden Rechtsträgers angesetzt. Der Betrag, um den der Ausgabebetrag der an die Anteilseigner der PVA für deren Geschäftsanteile gewährten Anteile das übergehende Reinvermögen der PVA zu Buchwerten aus der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2001 überstieg, wurde in 2002 als aufwandswirksamer Verschmelzungsverlust behandelt. Der Verschmelzungsverlust wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung 2002 unter der gesonderten Bezeichnung „Verschmelzungsverlust“ als Bestandteil des außerordentlichen Ergebnisses ausgewiesen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff. HGB) aufgestellt. Insbesondere waren die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) zu beachten. Darüber hinaus waren die Regelungen des Aktiengesetzes (AktG) zu beachten.

Bezüglich der Gewinn- und Verlustrechnung kam das Umsatzkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 3 HGB zur Anwendung.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen werden zu steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um linear ermittelte, planmäßige und - im Vorjahr - außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Nutzungsdauer der immateriellen Vermögensgegenstände, technischen Anlagen und Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt 3 - 13 Jahre.

Die Nutzungsdauer des Gebäudes in Kahla wird mit 25 Jahren veranschlagt.

Bewegliche Vermögensgegenstände werden im Zugangsjahr pro rata temporis abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten aktiviert. Bei voraussichtlich dauerhaft im Wert geminderten Beteiligungen wurde der niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Die Vorräte sind zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt, soweit nicht ein niedrigerer Wert nach § 253 Abs. 3 HGB geboten ist.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden unter Anwendung des Niederstwertprinzips zu gewogenen Durchschnittseinstandspreisen bewertet. Der Wertansatz der fertigen und unfertigen Erzeugnisse beinhaltet den Materialaufwand zu Anschaffungskosten, die angefallenen Fertigungslöhne, Sondereinzelkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für das gesamte Vorratsvermögen gilt, dass Bestandsrisiken aufgrund der Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit, niedrigerer Reproduktionskosten oder gesunkener Wiederbeschaffungskosten bzw. nicht kostendeckender Verkaufspreise angemessen durch Einzelabschläge berücksichtigt sind.

Forderungen, flüssige Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nominalbetrag angesetzt.

Mögliche Ausfallrisiken bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden durch angemessene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen sind in Übereinstimmung mit § 253 Abs. 1 HGB in Höhe derjenigen Beträge gebildet worden, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig waren.

Die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen wurde aufgrund einer versicherungsmathematischen Berechnung unter Berücksichtigung des § 6a EStG und unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 6 % sowie der Richttafeln 1998 von Prof. Dr. Klaus Heubeck bewertet. Die Rückstellung für Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen umfasst die Aufwendungen für Löhne und Gehälter sowie die Aufstockungsleistungen. Diese Rückstellung wird für einzelvertragliche Vereinbarungen gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen sind zu Zugangskursen oder jeweils ungünstigeren Brief- bzw. Geldkursen zum Bilanzstichtag angesetzt worden.

Während des Geschäftsjahres erfolgt die Konvertierung von Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung zum jeweiligen amtlichen Mittelkurs des Tages des Geschäftsvorfalles.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Angaben zu den Positionen der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel (vgl. Anlage zum Anhang) dargestellt.

Finanzanlagen

Die folgenden Anteile sind – soweit sie sich im direkten Besitz der Gesellschaft befinden, mit Ausnahme der Vakuum-Anlagen Service GmbH – als Anteile an verbundenen Unternehmen ausgewiesen:

Name	Sitz	Kapital -anteil	Eigenkapital 31.12.2003	Ergebnis 2003
TePla America Inc.	Corona/ CA, USA	100,00 %	TEUR 5.108	TEUR 11
TePla France S.A.S.	Saint Quentin en Yvelines, Frank- reich	90,00%	TEUR - 318	TEUR - 209
UV Systec Gesellschaft für UV-Strahler und Systemtechnik mbH	Jena, Deutschland	100,00 %	TEUR 4.938	TEUR - 1.122
Crystal Growing Systems GmbH	Hanau, Deutschland	84,70% *)	TEUR 2.016	TEUR - 780
PVA Löt- und Werkstoff- technik GmbH	Jena, Deutschland	100,00 %	TEUR 96	TEUR - 44
PVA Control GmbH	ABlar, Deutschland	100,00 %	TEUR 98	TEUR 41

Name	Sitz	Kapital -anteil	Eigenkapital 31.12.2003	Ergebnis 2003
Vakuum-Anlagen Service GmbH	Hanau, Deutschland	100,00 %	*) siehe unten	
PVA USA Corp.	Manchester/ NH, USA	100,00 %	TEUR 24	TEUR - 22
PVA Vakuum- Anlagenbau Jena GmbH	Jena, Deutschland	100,00%	**) TEUR 233	TEUR 0***)
PVA MIMtech LLC	Cedar Grove/ NJ, USA	25,00%	****) TEUR 151	TEUR 10

*) nach Abzug eigener Anteile vom gezeichneten Kapital

**) mittelbare Beteiligung über die UV Systec Gesellschaft für UV-Strahler und Systemtechnik mbH

***) wegen Ergebnisabführungsvertrag

****) mittelbare Beteiligung über PVA USA Corp. (assoziiert)

Die Beteiligung an der Vakuum-Anlagen Service GmbH (100,00%, nach Abzug eigener Anteile) wurde im Vorjahr in voller Höhe abgeschrieben. Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung wurde über das Vermögen der Gesellschaft am 25. April 2003 das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Eigenkapital der Gesellschaft betrug am 31. Dezember 2002 TEUR - 448, das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2002 belief sich auf TEUR - 630.

Infolge der Ausübung einer Call Option der PVA USA Corp. in 2003 erhöht sich der Kapitalanteil an der PVA MIMtech, LLC, zum 1. Januar 2004 auf 50,00%.

Im Dezember 2003 wurde darüber hinaus die Verschmelzung der PVA USA Corp. auf die TePla America, Inc. mit Wirkung zum 1. Januar 2004 beschlossen. Die TePla America Inc. als aufnehmendes Unternehmen firmiert ab diesem Zeitpunkt als PVA TePla America, Inc.

Umlaufvermögen

Die Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen jeweils weniger als ein Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren in Höhe von TEUR 480 (Vorjahr TEUR 3.329) aus Lieferungen und Leistungen. Der Restbetrag in Höhe von TEUR 2.910 (Vorjahr TEUR 1.677) beinhaltet verzinsliche kurzfristige Finanzforderungen.

Eigenkapital

	01.01.2003 TEUR	Veränderung TEUR	31.12.2003 TEUR
Gezeichnetes Kapital	21.450		21.450
Kapitalrücklage	17.735		17.735
Gewinnrücklagen	614		614
Bilanzverlust	-22.538	-1.988	-24.526
	<u>17.261</u>	<u>-1.988</u>	<u>15.273</u>

Das Grundkapital ist eingeteilt in 21.449.988 nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil von je EUR 1,00. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind voll eingezahlt.

Die Ausübungsfrist für das im Jahr 1999 beschlossene bedingte Kapital in Höhe von bis zu EUR 100.000,00 war in 2002 bereits ungenutzt abgelaufen (Bedingtes Kapital I).

Die Hauptversammlung vom 6. Juni 2000 hat die Schaffung eines bedingten Kapitals in Höhe von bis zu EUR 100.000,00 beschlossen (Bedingtes Kapital II). Die Hälfte und damit 50.000 Optionsrechte wurden ausgegeben; die zweite Hälfte wurde nicht ausgegeben. Die Ausübungsfrist ist in 2003 abgelaufen. Die Optionen wurden von den Berechtigten nicht ausgeübt.

Es wurde nachfolgend kein weiteres bedingtes Kapital geschaffen.

Mit Beschluss der Hauptversammlung der TePla vom 28. August 2002 wurde der Vorstand ermächtigt, in der Zeit bis zum 5. November 2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 10.724.994,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital) und dabei das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Aus diesem genehmigten Kapital wurden im Jahr 2003 keine neuen Aktien ausgegeben.

Rückstellungen

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ergibt sich wie folgt:

	01.01.2003	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2003
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kündigungsbedingte Aufw.	484	422	62	0	0
Gewährleistung	685	235	164	117	403
Drohverlust Mietverträge	227	131	0	336	432
Urlaub	364	364	0	367	367
Überstunden/Gleitzeit	222	222	0	298	298
Börsenzulassung	200	200	0	0	0
Rücknahme Maschinen	187	187	0	0	0
Jahresabschlusserstellung und -prüfung	150	150	0	150	150
Droh. Darlehensverluste	100	100	0	0	0
Provisionen	100	42	0	310	368
Sonstige (jew. < TEUR 100)	329	193	9	368	495
	3.048	2.246	235	1.946	2.513

In den Sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen in Höhe von TEUR 37 für den mit einem Mitarbeiter unterzeichneten Altersteilzeitvertrag enthalten.

In den Rückstellungen für Drohverluste aus Mietverträgen sind langfristige Anteile in Höhe von TEUR 274 enthalten. Alle sonstigen Rückstellungen sind kurzfristig.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr und sind nicht von der Gesellschaft besichert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in branchenüblichem Umfang durch Eigentumsvorbehalte der Lieferanten gesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren in Höhe von TEUR 267 (im Vorjahr TEUR 232) aus Lieferungen und Leistungen. Der Restbetrag in Höhe von TEUR 1.795 (im Vorjahr TEUR 645) bezieht sich auf verzinsliche kurzfristige Finanzverbindlichkeiten, darunter ein kurzfristiges Darlehen von der Crystal Growing Systems GmbH, sowie Verbindlichkeiten aus steuerlicher Organschaft.

2. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die einzelnen Regionen und Produktbereiche wie folgt:

<u>Region</u>	<u>Mio. EUR</u>	<u>Geschäftsbereich</u>	<u>Mio. EUR</u>
Deutschland	10,4	Vakuum-Anlagen	18,0
Übriges Europa	4,7	Plasma-Anlagen	8,3
Nordamerika	2,1		
Asien	8,3		
Übrige	0,8		
	<u>26,3</u>		<u>26,3</u>

Materialaufwand

a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	TEUR	11.410
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	TEUR	1.062

Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter	TEUR	8.978
b)	Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung TEUR 345	TEUR	1.864

Aufwendungen für Restrukturierung

Zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Aufwands- und Ertragslage ist anzumerken, dass in folgenden Aufwandspositionen Aufwendungen für Restrukturierung enthalten sind. Es handelt sich um Aufwendungen, die zwar Ausfluss der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind (und somit nicht als außerordentliche Aufwendungen auszuweisen sind), aber aller Voraussicht nach einmaliger und ungewöhnlicher Natur sind.

	Herstellungskosten	Vertriebskosten	Allg. Verwaltungskosten	F&E-Kosten	sonst. betr. Aufwend.	gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abfindungen und sonst. kündigungsbed. Aufw.	64	16	24			104
Drohverlust Mietverträge					336	336
	<u>64</u>	<u>16</u>	<u>24</u>	<u>0</u>	<u>336</u>	<u>440</u>

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Unter den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag werden Körperschaftsteuererstattungsansprüche aus Gewinnausschüttungen der PVA für Vorjahre in Höhe von TEUR 140 ausgewiesen.

Ergänzende Angaben

1. Personal

Im Jahresdurchschnitt waren 163 (VJ 196) Mitarbeiter in der Gesellschaft tätig.
Am Jahresende waren 153 (VJ 194) Mitarbeiter beschäftigt.

2. Gesellschaftsorgane

Dem Vorstand gehörten im Berichtsjahr an:

- Peter Abel, Wettenberg (Vorsitzender)
Diplom-Ingenieur

Mitgliedschaften in Kontrollgremien:

Crystal Growing Systems GmbH, Hanau (Beiratsvorsitzender)

Biologie-Gesellschaft Mittelhessen mbH, Gießen (stv. Beiratsvorsitzender)

- Volker Lang, Bad Endbach (Vorstand Geschäftsbereich Vakuum-Anlagen)
Diplom-Ingenieur

Keine Mitgliedschaften in Kontrollgremien

- Martin Gier, Offenbach (Vorstand Geschäftsbereiche Kristallzucht- und - ab
15. Januar 2003 - Plasma-Anlagen)
Diplom-Ingenieur

Keine Mitgliedschaften in Kontrollgremien

- Craig A. Walker, Düsseldorf (Finanzvorstand bis 11. April 2003)
MBA

Keine Mitgliedschaften in Kontrollgremien

- Friedrich G. Meyer, Berg (Vorstand Geschäftsbereich Plasma-Anlagen bis
14. Januar 2003)
Diplom-Physiker

Keine Mitgliedschaften in Kontrollgremien

- Nina von Wesebe, Berlin (Finanzvorstand seit 16. April 2003)
Diplom-Betriebswirtin

Keine Mitgliedschaften in Kontrollgremien.

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands betragen im Geschäftsjahr 2003
TEUR 721.

Aktienoptionen wurden an Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2003 nicht
gewährt.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr an:

- Dr. Dietmar Kubis, Jena (Vorsitzender)
Vorstandssprecher der Deutsche Effecten- und Wechsel-
Beteiligungsgesellschaft AG, Jena

Weitere Mitgliedschaften in Kontrollgremien:
4MBO International Electronic AG, Plochingen (Vorsitzender des
Aufsichtsrats)
4flow AG, Berlin (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
JENOPTIK Leasing GmbH & Co. KG, Jena (Beirat)
Frauenthal Keramik AG, Wien (stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Prof. Dr. Heiner Ryssel, Erlangen (stv. Vorsitzender)
Direktor des Fraunhofer Institutes für integrierte Systeme und
Bauelementetechnologie, Erlangen

Weitere Mitgliedschaften in Kontrollgremien:
West STEAG Partners GmbH, Essen
(Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats)
- Hartmut Böhle, Iffeldorf
Geschäftsführender Gesellschafter der Klaus Kleinmichel GmbH, Bernried

Keine weiteren Mitgliedschaften in Kontrollgremien
- Michael Daniel, Jena
Chefsyndikus Jenoptik AG, Jena

Weitere Mitgliedschaften in Kontrollgremien:
JENOPTIK Pension Trust e.V., Jena (Mitglied des Anlageausschusses)
friendly sensors AG, Jena (stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Wolfgang Dondorf, Gummersbach (bis 12. Juni 2003)
Vorstandsvorsitzender der Pfeiffer Vacuum Technology AG, Aßlar

Keine weiteren Mitgliedschaften in Kontrollgremien
- Dr. Peter Friedemann, Königsbrunn
HV-Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre (SdK), München

Keine weiteren Mitgliedschaften in Kontrollgremien
- Bernhard Zeller, Frankfurt a.M. (seit 12. Juni 2003)
Geschäftsführer der HBB Capital Advisers GmbH, Frankfurt a. M.

Weitere Mitgliedschaften in Kontrollgremien:
Crystal Growing Systems GmbH, Hanau (Beiratsmitglied)
FARGO Preß- und Stanzwerk GmbH, Groß-Gerau (Beiratsmitglied)
FEC Consult Gesellschaft für Management- und Beratungsberatung mbH,
Frankfurt a.M. (Mitglied des Aufsichtsrats)

Die Bezüge des Aufsichtsrates beliefen sich auf TEUR 39 im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Zur Deckung der zivilrechtlichen Haftung von Organmitgliedern wurde eine D&O-Versicherung abgeschlossen. Die hierfür gezahlten Prämien betragen in 2003 TEUR 18.

3. Sonstige Angaben

Für ehemalige Mitglieder des Geschäftsführungsorgans wurden im Jahr 2003 Pensions-, Gehalts- und Abfindungsaufwendungen in Höhe von insgesamt TEUR 119 geleistet. Zum Bilanzstichtag besteht für derartige Pensionsverpflichtungen eine Rückstellung von TEUR 132.

Der PVA Vakuum-Anlagenbau Jena GmbH wurden in 2000 und 2001 aus dem Förderprogramm Europäischer Fonds für regionale Entwicklung über die Thüringer Aufbaubank Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt TEUR 714 gewährt. Neben der Zuwendungsempfängerin ist die PVA TePla in Höhe von TEUR 530 zur Rückzahlung der bewilligten Investitionszuschüsse verpflichtet, wenn gegen die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) verstoßen wird (insbesondere Schaffung von 9 Dauerarbeitsplätzen). Der Überwachungszeitraum zur Schaffung von Dauerarbeitsplätzen endet am 31. Dezember 2005. Zur Absicherung etwaiger Rückzahlungsverpflichtungen hat die PVA TePla einen öffentlich-rechtlichen Schuldbeitritt erklärt.

Das Tochterunternehmen UV Systemec Gesellschaft für UV-Strahler und Systemtechnik mbH hat Investitionsdarlehen in Höhe von insgesamt TEUR 972 aufgenommen (Darlehen in Höhe von TEUR 640, rückzahlbar bis Juni 2009; Darlehen in Höhe von TEUR 332, rückzahlbar bis Dezember 2022). Die Darlehen sind u.a. durch eine Grundschuld besichert. PVA TePla hat für diese Darlehen eine Patronatserklärung zugunsten des Kreditinstituts abgegeben.

Das Tochterunternehmen PVA Löt- und Werkstofftechnik GmbH hat ein bis zum März 2013 rückzahlbares Investitionsdarlehen in Höhe von TEUR 429 aufgenommen. Das Darlehen ist u.a. durch die Sicherungsübereignung der investierten Anlage sowie durch Grundschulden besichert. PVA TePla hat auch für dieses Darlehen eine Patronatserklärung zugunsten des Kreditinstituts abgegeben und ist eine Rücknahmeverpflichtung für die mit diesem Darlehen finanzierte Anlage eingegangen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gesellschaft aus Miet- oder Leasingverträgen sowie längerfristigen Vereinbarungen in der Beschaffung gliedern sich bezüglich ihrer Restlaufzeit wie folgt:

Restlaufzeiten

- | | |
|---------------------------|------------|
| • bis ein Jahr | 1.690 TEUR |
| • über ein bis fünf Jahre | 3.374 TEUR |
| • über fünf Jahre | 1.379 TEUR |

Entsprechenserklärung

Die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat zum Corporate Governance Kodex wurde abgegeben und den Aktionären zugänglich gemacht.

Angaben gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Herr Peter Abel, Wettenberg, hat uns nach den §§ 21 Abs. 1, 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an unserer Gesellschaft am 5. November 2002 die Schwelle von 25 %

überschritten hat und nun 29,99 % beträgt. Davon sind ihm 29,32 % der Stimmrechte nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 WpHG zuzurechnen.

Die PVA Konsortialgesellschaft mbH, Aßlar, hat uns nach § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an unserer Gesellschaft am 5. November 2002 die Schwelle von 10 % überschritten hat und nun 22,31 % beträgt.

Herr Wilhelm Hofmann, Biebertal, hat uns nach § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an unserer Gesellschaft am 5. November 2002 die Schwelle von 5 % überschritten hat und nun 7,52 % beträgt.

Die JENOPTIK AG, Jena, hat uns nach § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an unserer Gesellschaft am 5. November 2002 die Schwelle von 5 % überschritten hat und nun 5,08 % beträgt.

Die DEWB AG, Jena, hat uns nach § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an unserer Gesellschaft am 5. November 2002 die Schwelle von 25 % unterschritten hat und nun 12,9 % beträgt.

Die DEWB AG, Jena, hat uns nach § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sie durch Veräußerung der von ihr gehaltenen Anteile am 26. November 2003 die Beteiligungsschwelle von 5 % der Stimmrechte an unserer Gesellschaft unterschritten hat und sie seitdem keine Stimmrechte an unserer Gesellschaft hält.

Die JENOPTIK AG, Jena, hat uns nach § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 19. Dezember 2003 die Beteiligungsschwelle von 10 % der Stimmrechte an unserer Gesellschaft überschritten hat und seit diesem Tag 17,95 % beträgt.

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die vorstehenden Angaben gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG den seinerzeit veröffentlichten Inhalt der jeweiligen Mitteilung wiedergeben. Über zwischenzeitlich erfolgte nicht mitteilungspflichtige Anteilsverfügungen, die die genannten Anteilsquoten verändert haben können, liegen der Gesellschaft keine Informationen vor.

Die PVA TePla stellt einen nach § 292a HGB befreienden Konzernabschluss nach US-GAAP auf, in den die in Abschnitt B. 1. Finanzanlagen genannten verbundenen Unternehmen einbezogen sind. Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Gewinnverwendung/Bilanzverlust

Der Jahresabschluss der PVA TePla AG weist zum 31. Dezember 2003 einen Bilanzverlust in Höhe von TEUR 24.526 aus. Ein Vorschlag über die Gewinnverwendung von Vorstand und Aufsichtsrat entfällt damit. Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Aßlar, den 16. März 2004

Der Vorstand

Peter Abel

Martin Gier

Volker Lang

Nina von Wersebe

PVA TePla AG, Aßlar (i. Vj. Feldkirchen)

Anlagenspiegel per 31. Dezember 2003

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			
	1.1.2003	Zugänge	Abgänge	31.12.2003
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.435.175,27	40.182,05	22.087,80	1.453.269,52
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.353.642,88	9.754,68	0,00	1.363.397,56
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.050.028,73	7.918,04	1.098,64	2.056.848,13
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.881.964,96	112.063,00	83.602,47	3.910.425,49
	<u>7.285.636,57</u>	<u>129.735,72</u>	<u>84.701,11</u>	<u>7.330.671,18</u>
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen	15.688.727,84	0,00	0,00	15.688.727,84
	<u>24.409.539,68</u>	<u>169.917,77</u>	<u>106.788,91</u>	<u>24.472.668,54</u>

Anlage zum Anhang

1.1.2003	Abschreibungen		31.12.2003	Buchwert	Buchwert
EUR	Zugänge	Abgänge	EUR	31.12.2003	31.12.02
	EUR	EUR		EUR	EUR
687.994,75	210.717,54	22.087,80	876.624,49	576.645,03	747.180,52
228.918,04	85.200,68	0,00	314.118,72	1.049.278,84	1.124.724,84
1.563.465,88	152.980,04	1.098,64	1.715.347,28	341.500,85	486.562,85
2.760.493,52	526.324,51	78.577,17	3.208.240,86	702.184,63	1.121.471,44
<u>4.552.877,44</u>	<u>764.505,23</u>	<u>79.675,81</u>	<u>5.237.706,86</u>	<u>2.092.964,32</u>	<u>2.732.759,13</u>
3.688.900,00	0,00	0,00	3.688.900,00	11.999.827,84	11.999.827,84
<u>8.929.772,19</u>	<u>975.222,77</u>	<u>101.763,61</u>	<u>9.803.231,35</u>	<u>14.669.437,19</u>	<u>15.479.767,49</u>

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der PVA TePla AG, Ablar (i.Vj. Feldkirchen), für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der PVA TePla AG. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Frankfurt am Main, den 18. März 2004

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wagenseil
Wirtschaftsprüfer

Wehner
Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.